科学研究費助成事業 研究成果報告書

平成 29 年 6 月 7 日現在

機関番号: 13903 研究種目: 挑戦的萌芽研究 研究期間: 2015~2016

課題番号: 15K13499

研究課題名(和文)人工超格子多層膜による磁性トポロジカル状態の制御とフェルミオロジー

研究課題名(英文)Fermiology and controlling magnetic topological state in artificial superlattice thin films

研究代表者

宮崎 秀俊 (Hidetoshi, Miyazaki)

名古屋工業大学・工学(系)研究科(研究院)・准教授

研究者番号:10548960

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,000,000円

研究成果の概要(和文): 近年、薄膜表面における空間対称性の破れに伴うディラックコーンと呼ばれる特殊な電子状態により出現する「量子異常ホール効果」がエネルギー損失を伴わない電力輸送を実現する可能性が報告された。Euo/SmO人工超格子多層膜において、薄磁性薄膜よりも高い温度で量子ホール効果が発現することが理論的に予言されたものの、EuoやSmOは熱力学的に不安定な物質であるために通常の結晶合成法では作製が困難であることが知られている。 そこで、本研究では、様々な成膜条件下において、Sm酸化物薄膜を成長させ、結晶構造および電子状態を詳細に評価することにより、熱力学に不安定なSmO薄膜が得られてとを示した

に評価することにより、熱力学に不安定なSmO薄膜が得られことを示した。

研究成果の概要(英文): Topological insulators are materials which exhibit a fundamentally new physical phenomena that were first predicted by theorists. Recently, SmO is predicted to have a topological nontrivial ground state at ambient pressure.
In this study, we succeeded to fabricate SmO thin films by molecular beam epitaxy method controlled

precisely adjusting the substrate temperature and oxygen partial pressure.

研究分野: 物性物理

キーワード: トポロジカル絶縁体 サマリウム酸化物 薄膜 分子線エピタキシー法

1.研究開始当初の背景

近年、薄膜表面における空間対称性の破れに伴うディラックコーンと呼ばれる特殊な電子状態により出現する「量子異常ホール参実現する可能性が報告された。しかしながら、この物理現象は極低温下でのみ発現が必要不知が必要の強いスピン軌道相互作のが必要を表した。近年、EuO/SmO人工超格子用膜において、その強いスピン軌道相互作用がよび大きな磁気モーメントにより希薄磁がよりも高い温度で量子ホール効果が発現することが理論的に予言されたものであるために通常の結晶合成法では作製が困難であることが知られている。

2.研究の目的

そこで、SmO 単結晶薄膜の作製の前段階として、アモルファスガラス基板上に様々な酸素分圧における Sm を蒸着することにより、サマリウム酸化物薄膜の基礎データを得ることを目的として研究を行った。また、その後、様々な成膜条件下において、Sm 酸化物薄膜を成長させ、結晶構造および電子状態を詳細に評価することにより、熱力学に不安定な SmO 薄膜が得られているかを詳細に評価し、SmO の実現を目的とする。

3.研究の方法

Sm酸化物薄膜は、分子線エピタキシー法を用いて蒸着を行った。純度 99.9 %の高純度 Sm 金属をルツボに入れ、K-cell を加熱し蒸着するとともに、高精度に流量を制御した高純度酸素ガスを様々な酸素分圧で製膜装置内に流入させることにより Sm 酸化物薄膜の成膜を行った。蒸着中の基板温度は 673 Kに設定した。

4. 研究成果

(1) ガラス基板上に酸素雰囲気下でサマリ ウムを蒸着したサマリウム酸化物薄膜

ガラス基板上に様々な酸素分圧で製膜した Sm 酸化物の X 線回折測定の結果を図 1 , 図 2 に示す。ここで、X 線回折図形に見られる低角度側 (20°付近) での大きなブロードピークは、 SiO_2 基板のアモルファス構造によるハローピークである。図 1 に Sm2O3 の主要なピークを示した。この結果から、今回作製した試料では Sm_2O_3 が形成していたことが明らかになった。

作製した Sm₂O₃ 薄膜の構造のより詳細な酸素分圧依存性を議論するために得られた X 線回折測定の結果から算出した格子定数の酸素分圧量依存性を図 3 に示す。酸素分圧の増加に伴い格子定数は徐々に増加する傾向を示し、5.0 x 10⁻³ Pa 以上で、バルク Sm₂O₃の格子定数と一致した。一般的に酸化物薄膜の作製時に酸素分圧が過小な条件では酸素欠損が多く導入され、その結果、酸素欠損によ

る格子定数が減少する傾向にある。今回の結果から酸素分圧量の変化に伴い、格子定数が変化していることが明らかとなったため、酸素分圧量の変化が試料の結晶性や酸素欠陥に影響を及ぼし、その結果、電子構造が変化することが示唆される。

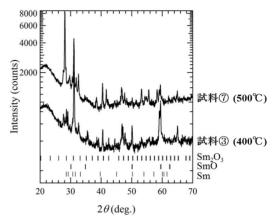


図 1 酸素分圧量 5.0 x 10⁻³ Pa で成膜したガラス基板上におけるサマリウム酸化物薄膜の X 線回折測定の基板温度依存性。

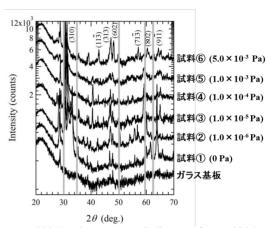


図2 基板温度400 で成膜したガラス基板上におけるサマリウム酸化物薄膜のX線回折測定の酸素分圧依存性。

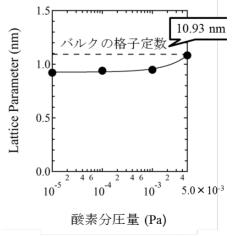


図3 基板温度400 で成膜したガラス基板上におけるサマリウム酸化物薄膜の格子定数の酸素分圧依存性

そこで、酸素欠陥量の変化が電子構造に及ぼす影響を評価するために、可視紫外分光光度計を用いたバンドギャップ評価を行った。様々な酸素分圧下で製膜した Sm₂O₃ 薄膜の可視紫外分光高度計による透過スペクトルを図 4 に示す。酸素分圧が 1.0 x 10⁻⁶ Pa よりも十分に小さい試料では、Sm は金属として存在するため、透過率はほぼ 0%であったため、省略する。酸素分圧の増大に伴い、透過スペクトルが徐々に低波長側にシフトしており、バンドギャップの増大が示唆される。

吸収端の波長はバンドギャップに相当す るので、吸収が立ち上がる部分に直線をフィ ッティングし、それがベースラインと交わる ところの波長を求め、その波長を光エネルギ ーに変換することで、バンドギャップを算出 することが可能である。そこで、図5に透過 スペクトルから見積もったバンドギャップ 値の酸素分圧依存性を示す。酸素分圧が増加 するにつれ、バンドギャップは大きくなりバ ルク値である 4.33 eV に近づく傾向を示した。 XRD 回折測定において、酸素分圧量の増加に 伴い格子定数が増大していくことと併せて 考察することにより、酸素分圧の増加に伴い 酸素欠陥が減少し、結果としてバンドギャッ プの増大につながったと考えられる。以上の 結果、酸素分圧のコントロールによりバンド ギャップサイズのコントロールが可能なこ とを見出した。

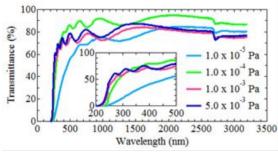


図 4. 様々な酸素分圧下で蒸着した Sm203 薄膜の透過スペクトルの酸素分圧依存性。

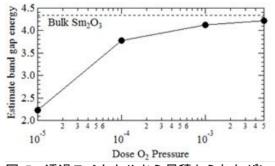


図 5. 透過スペクトルから見積もられたバンドギャップの酸素分圧依存性。。

(2) YSZ 基板上に酸素雰囲気下でサマリウム を蒸着したサマリウム酸化物薄膜

図 6(a) に特定の基板、酸素分圧、基板温度で製膜した SmO の X 線回折測定の結果を示す。

基板の(100)回折ピークの他には SmO(111)、表面酸化膜に由来すると考えられる Sm_2O_3 の回折ピークが観測された。このことから SmOが YSZ(100)基板上に成長していることが示唆される。

今後は、電子状態の直接観測を行うことにより、2 価の Sm が形成するトポロジカル状態の直接観測を試み、その状態を制御する方法の探索を行って行く予定である。

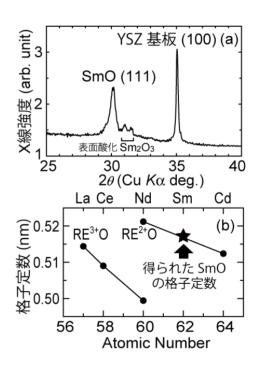


図 6 YSZ 基板上に製膜した SmO 薄膜の X 線回折測定 (a)および回折ピーク位置から算出 された SmO の格子定数と関連物質の格子定数 との比較。

5 . 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計 1 件)

H. Miyazaki, Y. Sakai, K. Yoshikawa and Y. Nishino, Photoemission study on Sm-oxide thin films prepared by molecular beam epitaxy, UVSOR Activity Report 2017, in

press. [査読無し]

〔その他〕

ホームページ等

http://enemat.web.nitech.ac.jp/index.ht

Μĺ

http://miyazaki-lab.science/index.html

6.研究組織

(1)研究代表者

宮崎 秀俊 (MIYAZAKI, Hidetoshi) 名古屋工業大学・大学院工学研究科・准教

研究者番号:10548960